

導入年度	H2年度	設備名	粒度分布測定装置		
メーカー	堀場製作所（株）	型式	LA-700	設置室	資源利用実験室

### 《 概要 》

粉体・粉粒体の特性は、粒度分布により大きく変化します。その為、必要な特性を得るべく粉碎・分級あるいは造粒することにより粒度分布をコントロールしています。そして、目的の粒度分布かどうかを確認するために粒度分布測定装置が必要になります。本装置は素材となる粉粒体の大きさと分布状態を測定する装置です。

### 《 原理 》

本装置はレーザ回折/散乱方式を採用し、光学系の切り換えなしに  $0.044\mu\text{m}$ ～ $260\mu\text{m}$  の粒子径範囲を一度に測定できます。高分子化学やセラミックスをはじめとする新素材分野での研究・開発・製造部門で威力を発揮します。

### 《 装置外観 》



### 《 仕様 》

- 光学系： 光源：He-Ne レーザ（632.8nm）、1mW  
タングステンランプ 50W
- 検出器： リング状 75 分割シリコンホトダイオード
- 循環系： 分散超音波バス 30W、22.5KHz（超音波プローブ式）  
循環遠心ポンプ段階可変により最大 10L（水の場合）
- セル： マニュアルフローセル、マニュアルバッチセル